(19)日本国特許庁(JP) (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2000-121661

(P2000-121661A) (43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)

(51) Int. C1. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 1 P 15/09

H O 1 L 41/08

G 0 1 P 15/09

H01L 41/08 Z

| 審査請求 | 未請求 | 請求項の数6 |
|------|-----|--------|
| | | · |

OL

(全9頁)

(21)出願番号

特願平10-297146

(22)出願日

平成10年10月19日(1998, 10.19)

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 多保田 純

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 100086597

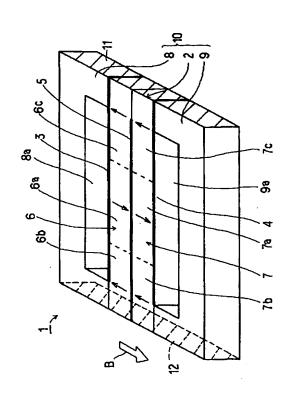
弁理士 宮▼崎▲ 主税

(54) 【発明の名称】加速度センサ及び加速度検出装置

(57)【要約】

【課題】 小型化を妨げることなく、静電容量の増大を 図ることができ、それによって低周波数の加速度を高精 度に検出でき、さらに電荷感度の低下が生じ難い加速度 センサを得る。

【解決手段】 第1, 第2の端部を有する短冊状の圧電 体2を有し、圧電体2の対向し合う一対の主面に第1, 第2の信号取出し電極3,4が形成されており、一対の 主面を結ぶ方向の中間に第1, 第2の信号取出し電極 3, 4と対向し合うように中間電極5が形成されてお り、圧電体2が第1, 第2の支持部材8, 9により両端 で支持されており、圧電体2の中央領域において圧電体 が厚み方向に分極処理されており、第1, 第2の信号取 出し電極3, 4が圧電体2の第1の端部に引き出されて おり、中間電極5が圧電体の第2の端部に引き出されて いる、加速度センサ1。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1, 第2の端部を有する短冊状の圧電 体と、

前記圧電体の対向し合う一対の主面に形成された第1, 第2の信号取出し電極と、

前記圧電体の一対の主面を結ぶ方向の中間位置において 第1, 第2の信号取出し電極と対向し合うように形成さ れた中間電極と、

前記圧電体を両端で挟持して支持するように圧電体の第 1, 第2の主面にそれぞれ固定された第1, 第2の支持 10 部材とを備え、

前記圧電体の中央領域において、圧電体が厚み方向に分 極処理されており、

前記第1, 第2の信号取出し電極が圧電体の第1の端部 に引き出されており、

前記中間電極が圧電体の第2の端部に引き出されてい る、加速度センサ。

【請求項2】 前記圧電体の中央領域が厚み方向に分極 処理されており、圧電体の長さ方向において該中央領域 を挟んだ両側の外側領域が中央領域とは厚み方向におい 20 いる部分において中間電極56が形成されている。中間 て逆方向に分極処理されている、請求項1に記載の加速 度センサ。

【請求項3】 前記圧電体が、共に短冊状とされた上 で、主表面のそれぞれに信号取出し電極及び中間電極が 形成された一対の圧電セラミック板を、中間電極同士を 対面接合することにより構成されている、請求項1また は2に記載の加速度センサ。

【請求項4】 前記圧電体と、前記第1, 第2の支持部 材とが接合されてセンサ本体が構成されており、該セン サ本体の圧電体の第1, 第2の端部側の第1, 第2の端 30 面にそれぞれ第1,第2の外部電極が形成されている、 請求項1~3のいずれかに記載の加速度センサ。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の加速度 センサと、

前記加速度センサと電気的に並列に接続されたリーク抵 抗と、

前記リーク抵抗の両端の電圧を増幅する増幅器とを備え ることを特徴とする、加速度検出装置。

【請求項6】 請求項1~4のいずれかに記載の加速度 センサの出力に接続された電荷増幅器をさらに備えるこ 40 とを特徴とする、加速度検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、加速度センサ及び 加速度検出装置に関し、より詳細には、圧電バイモルフ 型の加速度センサ及び該加速度センサを用いた加速度検 出装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、バイモルフ型圧電素子を用いた加

324073号公報には、図5に示す加速度センサ51 が開示されている。

【0003】加速度センサ51では、図示の矢印方向に 分極処理された圧電板52,53が用いられている。圧 電板52,53は、短冊状の形状を有し、長さ方向中央 部52a, 53aが厚み方向において互いに逆方向に分 極処理されている。

【0004】また、図示の破線で示す部分の外側領域5 2b, 52cは、中央領域52aとは厚み方向において 逆方向に分極処理されている。圧電板53においても、 中央領域53aの両側に配置された外側領域53b,5 3 c は、中央領域 5 3 a とは厚み方向において逆方向に 分極処理されている。従って、互いに対向し合っている 外側領域52bと外側領域53bとが、並びに外側領域 52cと外側領域53cとが、それぞれ、厚み方向にお いて互いに逆方向に分極処理されている。

【0005】他方、圧電板52,53の各外側主面に は、信号取出し電極54,55がそれぞれ形成されてい る。また、圧電板52と圧電板53とが対面接合されて 電極56は、圧電板52,53の両端には至らないよう に形成されている。

【0006】他方、信号取出し電極54は、圧電板52 の一方端に引き出されており、信号取出し電極55は、 圧電板53の外側主面において、信号取出し電極54が 引き出されている側とは反対側の端部に引き出されてい る。

【0007】圧電板52,53の外側には、それぞれ、 略コの字状の支持部材57,58が接合されている。支 持部材57,58が接合されることにより、圧電板5 2,53を接合した構造が、両端近傍で支持されてい

【0008】また、上記圧電板52,53及び支持部材 57,58を接合した構造の一方端面には外部電極59 が形成されており、外部電極59は信号取出し電極55 に電気的に接続されている。同様に、外部電極59が形 成されている側とは反対側の端面にも図示しない外部電 極が形成されており、この外部電極は信号取出し電極5 4に電気的に接続される。

【0009】加速度センサ51では、図示の矢印A方向 に加速度が作用した場合、圧電板52,53が屈曲し、 該屈曲により生じた電荷が信号取出し電極54,55か ら取り出され、加速度を検出することができる。この加 速度センサ51は、圧電板52,53が両端近傍で支持 された構造であるため、加速度が作用した際の電荷発生 量が増大され、それによって小型化を図った場合でも検 出感度の低下が生じ難いとされている。

【0010】ところで、加速度センサ51では、小型化 及び検出感度の向上を図り得るものの、電極間の静電容 速度センサが種々提案されている。例えば、特開平6- 50 量が小さく、従って低い周波数の加速度を測定するのが

困難であるという問題があった。これを具体的に説明す る。

【0011】加速度センサ51における信号取出し電極 54と中間電極56との間、中間電極56と信号取出し 電極55との間、並びに、一対の外部電極間において、* *矢印A方向に加速度が作用した場合の発生電圧及び静電 容量を、下記の表1に示すように、それぞれ、V., V 2, Vp, C1, C2, 及びCp とする。

[0012]

【表1】

| 電極間 | 発生電圧 | 静電容量 |
|------------------|----------------|----------------|
| 信号取出し電極54-中間電極56 | V , | C, |
| 中間電極56-信号取出し電極55 | V , | C: |
| 一対の外部電極間 | V _P | C _P |

【0013】ここで、圧電板52,53の厚み、長さ及 び幅を同一とした場合、 $V_1 = V_2$ 及び $C_1 = C_2$ とな る。従って、V₁ , V₂ をV₀ 、C₁ , C₂ をC₀ と表 すと、加速度センサ51における矢印A方向に加速度が 作用した場合の発生電圧 V_P は、 $V_P = 2 V_o$ であり、 静電容量 C_P は $C_P = C_O$ / 2となる。

【0014】他方、上記加速度センサ51を用いて加速 度を検出する場合、加速度センサ51のインピーダンス が比較的高いため、通常、電圧増幅器または電荷増幅器 を使用するのが普通である。図6は、この種の電圧増幅 器を接続した加速度検出回路を示す回路図である。

【0015】図6において、加速度センサ51に並列に リーク抵抗Rが接続されている。また、加速度センサ5 1の出力側が、ボルテージフォロワ60の一方入力端に 接続されている。また、ボルテージフォロワ60の出力 端と他方入力端とが接続されている。

【0016】上記加速度検出装置では、出力電圧Vour V_P であり、ボルテージフォロワ60の出力は、十分低 いインピーダンスに変換される。

【0017】ところが、上記ボルテージフォロワ60を 構成する、例えばオペアンプやFETなどでは、入力端 子から流れ出すバイアス電流 i g が存在するため、上述 したリーク抵抗Rを接続する必要がある。すなわち、リ ーク抵抗Rを接続しなければ、加速度センサ51の静電 容量に充電され続け、電圧が飽和することになる。従っ て、上記リーク抵抗Rが必要である。

【0018】ところが、リーク抵抗Rは、圧電板52, 53で発生した電荷をもリークさせる。すなわち、加速 度の変化がゆっくりである場合、極端な場合直流の場合 には、電圧V_P が発生する前に電荷がリークしてしまう ことになる。従って、所定の検出電圧が得られなくな る。これを、周波数特性で表すと、図7に示すとおりと なる。

【0019】図7は、上述した加速度検出回路を用いた 場合の作用した加速度の周波数と、ボルテージフォロワ 60に入力される電圧V, との関係を示す。図7におい て、f。は、カットオフ周波数を示す。ここで、カット 50 図9に示す加速度センサ71では、厚み方向に分極処理

オフ周波数 f 。は f 。= $1/(2\pi RC_P)$ で求められ る。

【0020】従って、上記カットオフ周波数f。より低 い周波数の加速度を測定するには、Rを大きくするこ と、及び/または容量C_Pを大きくする必要がある。と ころが、抵抗Rを大きくすると、ボルテージフォロワ6 0のオフセット電圧が増大し、これを低減するには、バ 20 イアス電流の小さいオペアンプなどをボルテージフォロ ワとして使用する必要があり、コストが高くつくことに なる。

【0021】また、バイアス電圧の小さいオペアンプを 用いることが可能であるとしても、例えば10ΜΩを超 える大きなリーク抵抗Rを接続すると、リーク抵抗Rが 接続されるプリント基板をも含めて高度な耐湿対策が必 要となる。従って、リーク抵抗Rの抵抗値を大きくする にも種々の制約があった。

【0022】他方、容量Cpは、圧電板52,53の形 =増幅器入力電圧V: =加速度センサにおける発生電圧 30 状及び圧電板52,53を構成する材料の比誘電率εに より決定される。すなわち、 $C_P = \epsilon W \cdot L / T$ であ る。ここで、W、L及びTは、それぞれ、圧電板52, 53の幅、長さ及び厚みを示す。

> 【0023】ところが、厚みTを薄くすると機械的強度 が低下するため、厚みTを薄くするには限界がある。従 って、従来、容量CPを高めるためには、幅W及び/ま たは長さしを大きくする必要があった。しかしながら、 このような方法では、加速度センサ51の外形寸法が大 きくなり、かつコストも高くつく。

40 【0024】なお、図8に示すように電荷増幅器を用い た場合においても、オペアンプ61に並列に接続される リーク抵抗R及び容量Cを接続する必要があり、低周波 数の加速度を測定する場合には、上記リーク抵抗R及び 容量Cを大きくする必要があった。ところが、増幅器の 出力 V_{OUT} は $V_{OUT} = Q_P / C$ で決定されるので、大き な出力電圧を得るには、容量Cを必要以上に大きくする ことはできなかった。

【0025】また、図9に示すように、2枚の圧電素子 を並列接続した加速度センサも従来より知られている。

5

された圧電板72,73が貼り合わされている。圧電板 72の上面には、信号取出し電極74が、圧電板73の 下面には信号取出し電極75が形成されている。圧電板 72,73の接合面には、中間電極76が形成されてい

【0026】ここでは、加速度センサ71を取り付ける 基板77上に導電パターン78, 79が形成されてい る。導電パターン78に、信号取出し電極75が接続さ れている。同様に、信号取出し電極74についても、リ ード線80を介して導電パターン78に接続されてい る。中間電極76は、圧電板72,73の間から外側に 引き出されており、かつリード線81を介して導電パタ ーン79に接続されている。

【0027】加速度センサ71は、一端近傍において、 信号取出し電極75が導電パターン78に接合されるこ とにより、片持梁態様で支持されている。上記加速度セ ンサ71では、圧電板72,73を用いた圧電素子が並 列に接続されており、静電容量は高められるものの、上 記のように片持梁態様で加速度センサ71を支持してい るため、信号取出し電極74,75及び中間電極76か20 らの信号の取出しに必要な電気的接続構造が非常に複雑 であり、コストが高くつくという問題があった。

【0028】また、上記加速度センサ71においては、 さらにコンデンサを付加することにより、容量を増大さ せることができる。このような回路を、図10に示す。 図10に示すように、加速度センサ71に並列にコンデ ンサC。が接続されている。この加速度センサ71とコ ンデンサC。の後段に、図6に示したのと同様に、リー ク抵抗R及びボルテージフォロワ60が接続されてい の容量C_Pの3倍に設定した場合、カットオフ周波数f $c = 1 / (2 \pi \cdot R \cdot 4 C_P)$ となり、カットオフ周波 数 f 。を1/4にすることができる。しかしながら、こ の場合、逆に、発生電圧 V_i は、 $V_i = Q_P$ (4 C_P) ち、発生電圧 V: が1/4倍に低下してしまう。

[0029]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来 の直列接続型の加速度センサ51は、圧電板52,53 を貼り合わせてなる構造を有し、圧電板52,53を両 40 置は、請求項1~4のいずれかに記載の加速度センサ 端近傍で支持しているため、感度の向上及び小型化を図 り得るものの、低い周波数の加速度を検出することが困 難であり、低い周波数の加速度を検出しようとすると、 小型化を図ることができず、かつコストが高くつくとい う問題があった。

【0030】また、図9に示した並列接続型の従来の加 速度センサ71では、片持梁態様で支持されており、耐 機械的衝撃性が低いだけでなく、信号取出しに際しての 電気的接続構造が複雑であり、コストが高くつくという 問題があった。加えて、外付けのコンデンサC。を接続 50 加速度センサを説明するための斜視図である。

して静電容量の増大を図り、低周波数の加速度を検出し ようとした場合には、発生電圧V、が小さくなるという 問題があった。

【0031】本発明の目的は、上述した従来技術の欠点 を解消し、小型化を妨げることなく、静電容量の増大を 図ることができ、それによって低周波数の加速度を高精 度に検出することができ、さらに電荷感度の低下が生じ 難い加速度センサ及び加速度検出装置を提供することに ある。

[0032]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明に 係る加速度センサは、第1, 第2の端部を有する短冊状 の圧電体と、前記圧電体の対向し合う一対の主面に形成 された第1, 第2の信号取出し電極と、前記圧電体の一 対の主面を結ぶ方向の中間位置において第1, 第2の信 号取出し電極と対向し合うように形成された中間電極 と、前記圧電体を両端で挟持して支持するように圧電体 の第1、第2の主面にそれぞれ固定された第1、第2の 支持部材とを備え、前記圧電体の中央領域において、圧 電体が厚み方向に分極処理されており、前記第1, 第2 の信号取出し電極が圧電体の第1の端部に引き出されて おり、前記中間電極が圧電体の第2の端部に引き出され ていることを特徴とする。

【0033】請求項2に記載の発明では、前記圧電体の 中央領域が厚み方向に分極処理されており、圧電体の長 さ方向において該中央領域を挟んだ両側の外側領域が中 央領域とは厚み方向において逆方向に分極処理されてい

【0034】請求項3に記載の発明では、前記圧電体 る。ここで、コンデンサC。の容量を加速度センサ71 30 が、共に短冊状とされた上で、主表面のそれぞれに信号 取出し電極及び中間電極が形成された一対の圧電セラミ ック板を、中間電極同士を対面接合することにより構成 されている。

> 【0035】請求項4に記載の発明に係る加速度センサ では、前記圧電体と、前記第1,第2の支持部材とが接 合されてセンサ本体が構成されており、該センサ本体の 圧電体の第1, 第2の端部側の第1, 第2の端面にそれ ぞれ第1, 第2の外部電極が形成されている。

【0036】請求項5に記載の発明に係る加速度検出装 と、前記加速度センサと電気的に並列に接続されたリー ク抵抗と、前記リーク抵抗の両端の電圧を増幅する増幅 器とを備えることを特徴とする。

【0037】請求項6に記載の発明に係る加速度検出装 置は、請求項1~4のいずれかに記載の加速度センサの 出力に接続された電荷増幅器をさらに備えることを特徴 とする。

[0038]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施例に係る

【0039】加速度センサ1は、短冊状の圧電体2を用いて構成されている。圧電体2は、例えばチタン酸ジルコン酸鉛系セラミックスのような圧電セラミックスにより構成されている。

【0040】圧電体2の一方主面には、第1の信号取出し電極3が形成されている。第1の信号取出し電極3が形成されている主面とは対向し合う反対側の主面に第2の信号取出し電極4が形成されている。また、圧電体2の厚み方向(厚み方向とは一対の主面を結ぶ方向をいうものとする)中間位置に第1,第2の信号取出し電極3,4と対向し合うように中間電極5が形成されている。

【0041】すなわち、第1の信号取出し電極3と中間 電極5が圧電体層6を介して厚み方向に対向されてお り、中間電極5と第2の信号取出し電極4とが圧電体層 7を介して厚み方向に対向されている。

【0042】なお、圧電体層6,7をそれぞれ焼成済の 圧電セラミック板で構成し、一対の圧電セラミック板を 中間電極5を介して貼り合わせることにより、すなわち 対面接合することにより圧電体2を構成してもよい。

【0043】圧電体層6においては、中央領域6aが図示の矢印方向で示すように厚み方向に分極処理されている。他方、圧電体層6の中央領域6aの両側の外側領域6b,6cは、中央領域6aとは厚み方向において逆方向に分極処理されている。

【0044】圧電体層7においては、中央領域7aが圧電体層6の中央領域6aと同じ方向に分極処理されており、外側領域7b,7cが圧電体層6b,6cと同じ方向に分極処理されている。

【0045】なお、中央領域6a,7aと、外側領域6b,6c,7b,7cとの境界を、図1において破線で示すこととする。本実施例では、信号取出し電極3,4は、圧電体2の第1の端部に引き出されており、中間電極5が圧電体2の第1の端部とは反対側の端部である第2の端部に引き出されている。従って、圧電体層6、信号取出し電極3及び中間電極5で構成される圧電素子と、圧電体層7、中間電極5及び信号取出し電極4で構成される圧電素子とが並列に接続されている。

【0046】また、圧電体2を両端近傍で支持するために、圧電体2の信号取出し電極3が形成されている側の 40 主面に第1の支持部材8が固定されている。同様に、圧電体2の信号取出し電極4が形成されている側の主面に第2の支持部材9が固定されている。

【0047】支持部材8,9は、圧電体2の両端近傍において、圧電体2の主面に固定されているが、支持部材

8,9には、それぞれ、凹部8a,9aが形成されている。すなわち、凹部8a,9aは、圧電体2の両端で支持されている部分間において、図示の矢印B方向に加速度が作用した際に、圧電体2の両端で支持されている部分間の領域を変位させるために設けられている。

【0048】上記支持部材8,9を構成する材料については、特に限定されず、例えば絶縁性セラミックス、合成樹脂などの適宜の部材により構成することができる。また、圧電体2に、支持部材8,9を固定することにより、センサ本体10が構成されている。このセンサ本体10の第1の端面に第1の外部電極11が形成されており、第1の端面とは対向する第2の端面に第2の外部電極12が形成されている。すなわち、圧電体2の第1の端部側に上記第1の端面が構成されており、従って信号取出し電極3,4が外部電極11に電気的に接続されている。同様に、センサ本体10の第2の端面は、圧電体2の第2の端部側に位置しており、外部電極12が中間電極5に電気的に接続されている。

【0049】加速度センサ1では、矢印B方向に、すな20 わち圧電体2の厚み方向に加速度が作用した場合、支持部材8,9で両端近傍が支持されている圧電体2の支持されている部分間の領域が変位し、該変位に基づく電荷が信号取出し電極3,4と中間電極5とで取り出される。この場合、中央領域6a,7aと、外側領域6b,6c,7b,7cとが逆方向に分極処理されているため、圧電体2の屈曲変位に基づいて発生した電荷により、より大きな電圧を送り出すことができる。

【0050】もっとも、図4に斜視図で示す変形例のように、圧電体層6,7は、上記のように分極処理されて30 いる必要は必ずしもなく、圧電体層6,7が、いずれも厚み方向において全領域が同じ方向に分極処理されていてもよい。もっとも、図1に示した実施例のように分極処理することにより、上述したように検出感度を高めることができ、好ましい。

【0051】本実施例の加速度センサ1を用いることにより、従来の加速度センサ51に比べて、より低周波数の加速度を効果的に検出し得ることを説明する。加速度センサ1における信号取出し電極3と中間電極5との間、中間電極5と信号取出し電極4との間、並びに第1,第2の外部電極11,12間において、矢印B方向に加速度が作用した場合の発生電圧及び静電容量を、それぞれ、 V_1 、 V_2 、 V_P 、 C_1 、 C_2 及び C_P とする。

[0052]

【表 2】

| 電極間 | 発生電圧 | 静電容量 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 信号取出し電極3-中間電極5 | V, | C ₁ |
| 中間電極 5 一信号取出し電極 4 | V, | C: |
| 外部電極11-外部電極12 | V _P | C, |

【0053】いま、圧電体層6,7の寸法が同じである 場合、 $V_1 = V_2$ であり、かつ $C_1 = C_2$ となる。従っ て、V₁, V₂をV₀、C₁及びC₂をC₀と置き換え 10 る。従って、加速度センサ1における発生電圧VP=V 。となり、静電容量Cpは、Cp=2Coとなる。よっ て、図5に示した従来の加速度センサ51に比べると、 発生電圧は1/2倍であるが、静電容量が4倍と非常に 大きくされる。また、発生電荷 Q_P は、 $Q_P = 2 \cdot V_o$ · C。となり、従来の加速度センサ51に比べて2倍と なる。すなわち、電荷感度は2倍に向上する。

【0054】よって、本実施例の加速度センサ1を用い ることにより、従来の加速度センサ51に比べて、外形 寸法を大きくすることなく、静電容量の増大及び電荷感 20 度の向上を図ることができる。特に、静電容量について は、従来の加速度センサ51の静電容量の4倍となるた め、カットオフ周波数を1/4に下げることができ、低 周波の加速度を効果的に検出し得ることがわかる。

【0055】また、加速度センサ1では、上記のように 支持部材8,9を圧電体2の両端近傍に固定し、センサ 本体10が構成されており、センサ本体10の対向し合 う第1, 第2の端面に外部電極11, 12が形成されて いる。従って、圧電体2に設けられた信号取出し電極 3, 4及び中間電極5からの電極引出し構造を簡略化す 30 ることができる。

【0056】なお、加速度センサ1では、上記のように 発生電圧は従来の加速度センサ51の1/2倍と低下し ていたが、この発生電圧VP については、図10で示し たようにコンデンサC。を追加したことにより静電容量 を高めた従来例に比べれば2倍となる。 すなわち、コン デンサC。を付加することにより、より低い周波数の加 速度を測定しようとした従来例に比べると、発生電圧V P を2倍にし得ることがわかる。

【0057】従って、同じ大きさの加速度センサを構成 40 した場合、従来例に比べて、より低い周波数の加速度を 効率良く検出することができると共に、外付けのコンデ ンサを必要とせずに上記のように低周波数の加速度を検 出し得ることがわかる。

【0058】図2は、加速度センサ1を用いた加速度検 出装置の一例の回路図を示す。本実施例の加速度検出装 置では、加速度センサ1に並列にリーク抵抗Rが接続さ れている。すなわち、加速度センサ1の一方の外部電極 がアース電位に接続されており、リーク抵抗Rの一方端 もアース電位に接続されている。また、加速度センサ1 50 2つの定数を優先的に設定したとしても、従来例では、

の他方の電極、すなわち出力側の電極に、抵抗Rの他方 端が接続されている。

【0059】加速度センサ1及び抵抗R,の出力側が上 記のように共通接続されており、かつオペアンプ21の ー方入力端に接続されている。オペアンプ21の他方入 力端には、アース電位との間に抵抗R」が接続され、ま た、抵抗R」とボルテージフォロワ21の他方入力端と の間の接続点22と、オペアンプ21の出力側との間に 抵抗R2が接続されて、正転アンプを構成している。

【0060】本実施例の加速度検出装置において、低周 波数の加速度を効率良く検出し得ることを説明する。上 記回路構成において、 $(R_1 + R_2) / R_1 = K とおく$ と、加速度検出装置の出力電圧Vout は、Vout = Vp ・K=V。・Kとなる。また、カットオフ周波数f 。は、 $f_c = 1/(2\pi C_P \cdot R) = 1/\{2(2\pi C_P \cdot R)\}$ 。・R) } となる。なお、ここでK=1としたボルテー ジフォロワを用いることもできる。

【0061】また、バイアス電流igによるオペアンプ 21の出力端におけるオフセット電圧Voff は、Voff =R·ig·Kとなる。従って、増幅率K及びリーク抵 抗の抵抗値Rは、出力電圧Vout 、カットオフ周波数 f 。及びオフセット電圧Voff と相互に影響する。例え ば、増幅率Kを高めたり、あるいはカットオフ周波数 f 。を低下させるために、リーク抵抗RIの抵抗値を大き くすると、オフセット電圧Voff が大きくなる。従っ て、通常、より重要な特性を重視し、かつ全体の整合性 を図るように、回路定数を設定すればよい。

【0062】次に、上記加速度検出装置を、図10に示 した従来の加速度検出装置と比較することとする。ここ では、出力電圧とカットオフ周波数とが上記実施例の場 合と同一となるようにK及び抵抗Rの抵抗値を設定し、 従来例におけるオフセット電圧Voff を求める。

【0063】従来例では、Vout = Vp·K=2Vo· Kであるため、Kは1/2倍と小さくし得る。また、カ ットオフ周波数 $f_c = 1 / (2\pi \cdot C_P \cdot R) = 1 /$ (2π・ (Cp / 4)・R) であるため、抵抗Rは4倍 とする必要がある。従って、オフセット電圧Voffは、 $V_{off} = (4 R \times i_B \times K/2) = 2 (R \cdot i_B \cdot K)$ となる。よって、従来例では、上記実施例の場合に比べ てオフセット電圧Voffが2倍に悪化することになる。

【0064】なお、上記比較では、オフセット電圧V off に着目したが、これはあくまでも一例であり、他の

11

残りの1つの定数が悪化することになる。

【0065】また、図2では、リーク抵抗Rの両端の電 圧を増幅する増幅器を用いることにより加速度検出装置 を構成したが、図3に示すように、電荷増幅器を用いて 加速度検出装置を構成してもよい。ここでは、加速度セ ンサ1の出力が電荷増幅器としてのオペアンプ31の一 方入力端に接続されている。オペアンプ31の他方入力 端はアース電位に接続されている。また、オペアンプ3 1の一方入力端、すなわち加速度センサ1に接続されて いる側の入力端と、オペアンプ31の出力端との間に、 抵抗R及びコンデンサCが互いに並列に接続されてい

【0066】図3に示した加速度検出装置においては、 加速度センサ1による発生電荷が従来例に比べて2倍と されているので、電荷増幅器の出力電圧も2倍とされ る。

[0067]

【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば、短冊状 の圧電体の対向し合う一対の主面に第1, 第2の信号取 出し電極が形成されており、該圧電体の一対の主面を結 20 ぶ方向中間において第1, 第2の信号取出し電極と対向 し合うように中間電極が形成されており、該圧電体が第 1, 第2の支持部材により両端で支持されており、第 1, 第2の信号取出し電極が圧電体の第1の端部に引き 出されており、中間電極が圧電体の第2の端部に引き出 されている。従って、圧電体に加速度が作用した場合、 発生した電荷に基づく電圧が、第1, 第2の信号取出し 電極と、中間電極との間で取り出される。この場合、中 間電極の両側の圧電体層が並列に接続されていることに なるため、加速度センサの静電容量が大きくされ、それ 30 によって低周波数の加速度を、加速度センサの小型化を 妨げることなく高精度に検出することができると共に、 電荷感度の低下も生じ難い。

【0068】また、上記第1, 第2の信号取出し電極が 圧電体の第1の端部に引き出されており、中間電極が圧 電体の第2の端部に引き出されているので、外部との電 気的接続も容易である。

【0069】請求項2に記載の発明では、圧電体の中央 領域が厚み方向に分極処理されており、圧電体の長さ方 向において、該中央領域を挟んだ両側の外側領域が中央 40 の表面断面図。 領域と厚み方向において逆方向に分極処理されているの で、作用した加速度により発生した電荷に基づく電圧を より効果的に取り出すことができ、低周波数の加速度を より高精度に測定することができる。

【0070】請求項3に記載の発明では、圧電体が、共 に短冊状とされた上で、主表面のそれぞれに信号取出し 電極及び中間電極が形成された一対の圧電セラミック板 を、中間電極同士を対面接合することにより構成されて いるので、既に焼成された一対の圧電セラミック板を用 いて導電性接着剤または電気的導通が取れる程度の極薄 50

12 い絶縁性接着剤を用いて接合することにより、本発明に おける上記圧電体を容易に構成することができる。

【0071】請求項4に記載の発明では、圧電体と、第 1, 第2の支持部材とが接合されてセンサ本体が構成さ れており、該センサ本体の圧電体の第1, 第2の端部側 の第1, 第2の端面にそれぞれ、第1, 第2の外部電極 が形成されているので、第1, 第2の外部電極から加速 度が作用した際の出力電圧を容易に取り出すことができ ると共に、外部との電気的接続の容易化を図り得る。

【0072】請求項5に記載の発明に係る加速度検出装 置では、本発明に係る加速度センサと、該加速度センサ と電気的に並列に接続されたリーク抵抗と、リーク抵抗 の両端の電圧を増幅する増幅器とを備えるため、低周波 数の加速度を髙精度に測定することができると共に、リ 一ク抵抗の抵抗値、増幅時における増幅度を調整するこ とにより、カットオフ周波数を所望の値に容易に調整す ることができる。

【0073】また、請求項6に記載の発明では、加速度 センサの出力段に電荷増幅器が接続されているので、よ り大きな出力電圧を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る加速度センサの斜視

【図2】図1に示した実施例の加速度センサを用いた加 速度検出装置の回路構成を示す図。

【図3】図1に示した加速度センサの出力段に電荷増幅 器を接続してなる加速度検出装置を説明するための回路

【図4】図1に示した加速度センサの変形例を示す斜視 図。

【図5】従来の加速度センサの一例を示す斜視図。

【図6】従来の加速度センサに増幅回路を接続してなる 従来の加速度検出装置の回路図。

【図7】従来の加速度検出装置における作用した加速度 の周波数と、増幅器入力電圧との関係を説明するための

【図8】従来の加速度センサに電荷増幅器を接続してな る加速度検出装置の回路図。

【図9】従来の並列接続型加速度センサを説明するため

【図10】従来の加速度センサに並列に抵抗を接続し、 低周波数の加速度を測定するように構成された加速度検 出装置の回路図。

【符号の説明】

1…加速度センサ

2…圧電体

3, 4…第1, 第2の信号取出し電極

5…中間電極

6 a, 7 a … 中央領域

6b, 6c, 7b, 7c…外側領域

8, 9…第1, 第2の支持部材 10…センサ本体

11, 12…第1, 第2の外部電極

21…オペアンプ

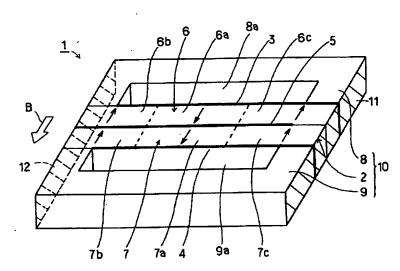
22…増幅器

31…オペアンプ

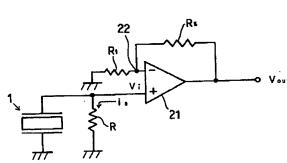
3 2…電荷増幅器

R』…リーク抵抗

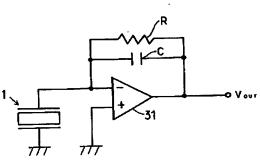
【図1】



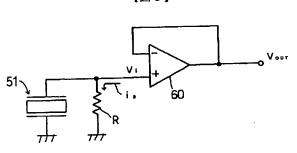
【図2】



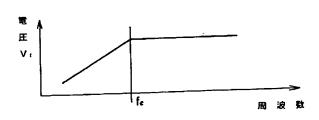
【図3】



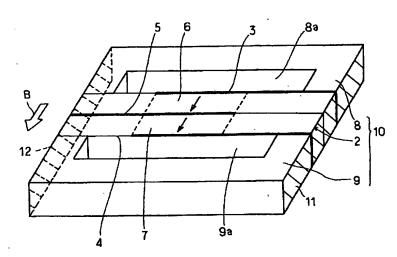
[図6]



【図7】

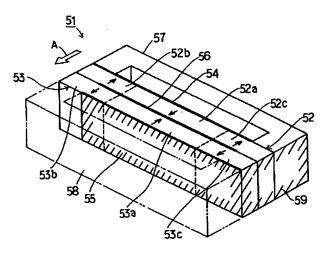


[図4]

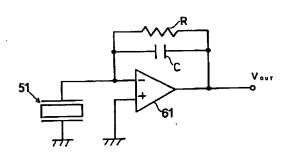


【図5】

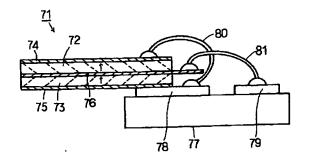
[図8]



【図9】



【図10】



71 V: Vous